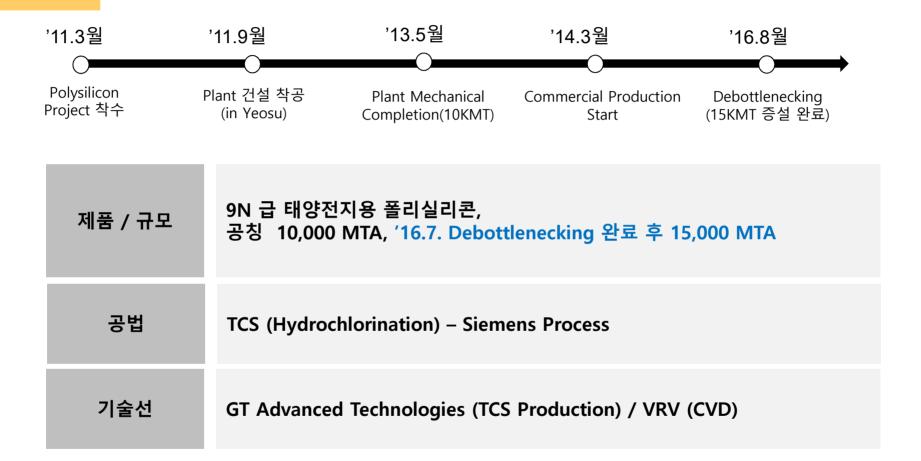


한화케미칼㈜ 폴리실리콘 공장 소개

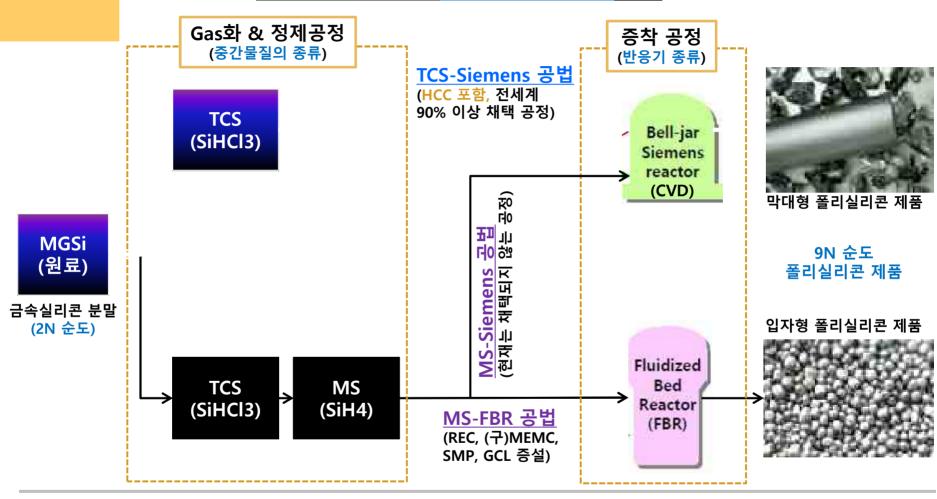
1. 폴리실리콘 공장 연혁





2. 폴리실리콘 생산 공법

<u>당사 채택공정 : TCS - Siemens 공법</u>



- 주1. TCS: TriChloroSilane (SiHCl3), MS: MonoSilane (SiH4)
- 주2. CVD: Chemical Vapor Deposition (화학기상증착)
- 주3. Siemens 반응기: CVD 반응을 이용한 종형의 Batch 증착 반응기를 Siemens에서 최초로 개발하여 Siemens 공법 혹은 반응기라 함
- 주4. FBR: Fluid Bed Reactor (유동층 반응기)



3. 유해화학물질 취급 현황

순번	물질명 (CAS No.)	함량 (%)	사용처	사고대비물질
1	황산 (7664-93-9)	98	TCS 공정 건조	•
2	염화수소 (7647-01-0)	20~100	TCS 공정, UTILITY 공정 중화	•
3	수산화나트륨 (1310-73-2)	20	UTILITY 공정 중화	X
4	질산 (7697-37-2)	68	CVD 공정 에칭	•
5	플루오르화수소 (7664-39-3)	50	CVD 공정 에칭	•
6	혼산 (질산+불산)	-	폐기	•
7	트리클로로실레인	100	폴리실리콘 제조용	•
8	실리콘테트라염화물	100	폴리실리콘 제조용	•



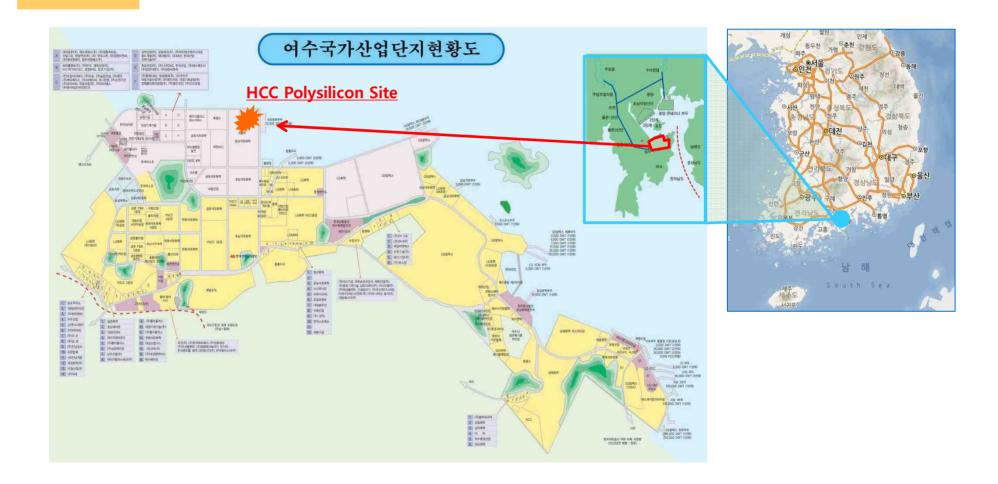
4. 부지

● 대지면적 : 40천 평 (Future 부지 15천 평)

● 건물 : 23동 (건축면적 8천 평)



4. 부지





감사합니다

